

## Model : NC-80MAP

### 非接触式（渦電流法）シート抵抗測定システム

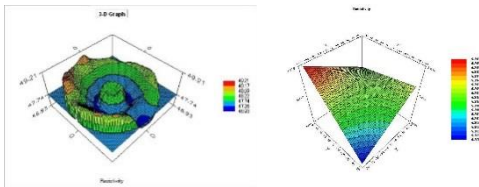


非接触測定でワイドな測定レンジを実現

高精度測定及び2D/3Dマッピング表示を備えたデータ管理機能

#### 機能・特長

- ・ 面内マルチポイント測定機能  
(プログラムパターン：Max.217点測定)  
\*任意のマルチポイントパターン設定可能
- ・ Windows 10 対応の専用ソフトウェア
- ・ 2-D/3-Dマッピング画像表示  
(マッピング画像はJPEG形式で保存)
- ・ SPCチャート表示機能
- ・ 測定データはCSVファイル形式で出力可能
- ・ 国際標準規格：ASTM F653準拠



#### 測定対象

- ・ ウェハサンプル；  
シリコンベア、化合物ウェハ、  
化合物上エピ、SiCなど
- ・ 各種薄膜サンプル；  
半導体プロセス膜、メタル膜、ITO膜など
- ・ その他  
\*原則として測定レンジ内であれば、どんな  
サンプルでも測定可能

#### 対象サイズ

サイズ：2～8インチ、156mm□  
厚さ：300～1,500μm  
\*12インチはオプション対応

#### 測定レンジ

プローブタイプ	測定レンジ
(1) Super Low	0.005 ~ 0.01 ohm/sq
(2) Low	0.01 ~ 0.5 ohm/sq
(3) Middle	0.5 ~ 10 ohm/sq
(4) High / Super High	10 ~ 3200 ohm/sq

\*プローブコア径（測定スポット径）：14 mm (S-Low, Lowは5mm対応も可能)



## 測定直線性

測定レンジ	%
0.005 ~ 0.01 ohm/sq	±2 %
0.01 ~ 0.05 ohm/sq	±2 %
0.05 ~ 10 ohm/sq	±2 %
10 ~ 1000 ohm/sq	±2 %
1000 ~ 3200 ohm/sq	±3 %

## 測定再現性

測定レンジ	%
0.005 ~ 0.01 ohm/sq	0.1 %
0.01 ~ 0.05 ohm/sq	0.1 %
0.05 ~ 10 ohm/sq	0.1 %
10 ~ 1000 ohm/sq	0.2 %
1000 ~ 3200 ohm/sq	0.7 %

\*測定再現性 (Typical) :  $CV = \frac{STDEV}{AVG} \times 100\%$  で計算。  
(標準抵抗サンプル : NIST・VLSIを使用し、同一点を10回繰返し測定)

## 測定スループット

測定点数	ライン測定	放射状測定
5	18s(±1s)	18s(±1s)
9	18s(±2s)	19S(±2S)
17	33s(±2s)	39S(±2S)
37	48s(±3s)	57S(±3S)
121	93s(±3s)	130s(±3S)
217	138s(±5s)	208s(±5S)

\*測定時間はφ4"ウエハ、測定プローブ指定設定の場合です。

☆弊社ウェブサイトにも本製品のムービーを掲載しております。[リンク](#)よりご覧下さい。

- 詳細のお問い合わせは下記までご連絡ください。
- 実機でのサンプル測定が可能です。お気軽にご相談下さい。
- 記載の仕様および外観は、予告なく変更する場合がございます。